

中型プローブ顕微鏡システムAFM5500M

走査型プローブ顕微鏡システム「AFM5500M」は、ナノレベルでサンプル表面の立体形状観察と物性マッピングを同時にを行うことができる装置である。広域フラットスキャナによりXY200 μm の広域走査に加えて歪みを改善した直線性の高い計測を実現する。さらにカンチレバーの装着・交換、光軸調整及び測定パラメータの調整等を自動化することでオペレーターの負担を大幅に軽減した。また、走査電子顕微鏡(SEM)との異種装置間で試料の同一場所を簡単に測定できるAFM&SEM リンケージシステムを搭載する。

主な特長

- (1) 広域で平らな試料の中にあるナノメートルレベルの凹凸構造やうねりの計測が可能
- (2) 測定のための準備から試料の測定までをワンクリックで自動に行うことが可能
- (3) 走査電子顕微鏡(SEM)と本機(AFM5500M)の異種装置間で、試料の同一場所を簡単に測定可能



SEM-AFM 同一箇所観察例 (試料: グラフェン/SiO₂)
形状像 (AFM) と電位像 (KFM) を SEM 画像に重ね合せたデータ

